

コンパクト型シタリングシステム SIN 20

開発試作用途から少量生産用途まで

新しいシタリング装置 SIN 20 は、焼結プロセスのセットアップ、評価、および最適化において研究開発および研究機関をサポートするために開発されました。

SIN 20 は、圧力均等化の技術原理に基づいて、PiNK社のこれまでの経験に基づいた技術にて、特許を取得した平衡真空技術を使用しています。これにより、N₂雰囲気だけでなく、ギ酸などの還元雰囲気でも焼結できます。

Cu基板だけでなく、AuまたはAg仕上げの基板も焼結可能となっております。

トップツールシステムは簡単に取り付け、交換できます。これにより、異なるツール間での迅速な変更が可能になります。さらに、PiNK のソフト ツール ソリューションにより、ユーザーはトップ ツールを変更することなく、さまざまなレイアウトの焼結を実行できます。このツールの柔軟性により、開発サイクルが短縮され、R&D コストが最小限に抑えられます。このソフトツールを使えば、ワンステップの多層焼結も可能です。

SIN 20 は短いセットアップ時間で使用可能です。直感的なユーザーインターフェイスは、プロセスエンジニアがさまざまなプロセス ステップを設定および分析するのをサポートします。そのサイズと柔軟性に基づいて、装置は R&D だけでなく、幅広いコンポーネントの小規模製造にも適しています。

システムの特長

- 柔軟なトップツールシステム
(高プレス圧のソフトツールまたはハードツール)
- 対象アプリケーション:
 - 基板とリードフレームへのダイアタッチ
 - ベースプレートへの基板の取り付け
 - ダイトップ相互接続
 - ハイパワーLED接合

装置仕様

- 密閉されたプロセスチャンバー
- プロセスエリア:
 - 焼結: 最大 100 x 100 mm
 - ワーク最大高さ: 50 mm
 - 最小製品間距離: 0mm
- 加熱システム:
 - 350 °C までの加熱プレート温度
 - 独立した冷却ゾーンと加熱ゾーン
- トップツールシステム:
 - 1 kN から 200 kN までダイナミックに適応可能なプレス力
 - 連続プレス力: 175 kN
 - 最大動的適応圧力
ソフトツールで最大 30 MPa
ハードツールで最大 60 MPa
 - 圧力の動的制御および監視
 - ドライブ速度: 上向き最大 17.5 mm/秒、
下向き最大 27.5 mm/秒
- 雰囲気制御システム:
 - 固有ガス雰囲気の正確な制御
(N₂、N₂/O₂、N₂/H₂、HCOOH)
 - 気圧範囲: 1 - 960 mbar
- プロセス制御とユーザーインターフェイス:
 - 温度、気圧、および圧力プロファイルを自由にプログラムして制御および監視
 - 恒久的なプロセス制御
- 接続性:
 - イーサネット インターフェイス
 - リモートメンテナンス (VPN)
- 低エネルギーおよびプロセス媒体の低消費

ピンク・ジャパン株式会社

〒106-0032
東京都港区六本木3-6-9
K2ビル
TEL: 03 5777 0602
FAX: 03 5777 0604
info@pink-japan.co.jp
www.pink.de/jp

PiNK GmbH Thermosysteme

Am Kessler 6
97877Wertheim, Germany
T +49 (0)9342 919-0
F +49 (0)9342 919-111
info@pink.de
www.pink.de



本製品の詳細はこちら

